

## ПЬЕЗО-ХОЛЛ-ЭФФЕКТ В *p*-КРЕМНИИ

Тарасик М. И., Шварков Д. С., Янченко А. М.

Приведены результаты исследований пьезо-холл-эффекта в *p*-кремнии, легированном бором ( $\text{Si}\langle\text{B}\rangle$ ), индием ( $\text{Si}\langle\text{In}\rangle$ ) и облученном электронами ( $\text{Si}\langle\text{e}\rangle$ ). Зависимости постоянной Холла от величины одноосной нагрузки в  $\text{Si}\langle\text{B}\rangle$  объясняются с учетом перераспределения легких и тяжелых дырок и изменения их эффективных масс.

Получены изменения положения уровня Ферми при одноосной деформации кристаллов  $\text{Si}\langle\text{In}\rangle$  и  $\text{Si}\langle\text{e}\rangle$ , поведение которых интерпретируется для  $\text{Si}\langle\text{In}\rangle$  расщеплением уровня индия при снятии электронного вырождения, а в  $\text{Si}\langle\text{e}\rangle$  — расщеплением уровня дефекта  $E_v + 30$  эВ вследствие снятия ориентационного вырождения и конфигурационной перестройки дефекта. Определены скорости смещения компонент расщепления энергетических уровней дефектов.

Применение одноосных нагрузок позволяет получить сведения о свойствах симметрии электрически активных дефектов структуры в многодолинных полупроводниках с энергетическими уровнями, расположенными в верхней половине запрещенной зоны [1-3]. Представляет интерес получение подобной информации для дефектов с уровнями у валентной зоны.

В работе приведены результаты исследований поведения постоянной Холла  $R_H$  в условиях одноосной нагрузки  $P$  в кремнии, легированном бором ( $1 \cdot 10^{15} - 1 \cdot 10^{16}$  см $^{-3}$ ), индием (до  $1 \cdot 10^{17}$  см $^{-3}$ ), а также облученном электронами (до  $\Phi_e = 1 \cdot 10^{16}$  эл./см $^2$ ). Температурные зависимости концентрации носителей заряда в  $\text{Si}\langle\text{In}\rangle$  определялись дефектами с энергетическим уровнем  $E_v + 0.16$  эВ, а в  $\text{Si}\langle\text{e}\rangle$  — с  $E_v + (0.30 \pm 0.02)$  эВ (рис. 1, *a*). Зависимости  $R_H(P)$  в этих кристаллах снимались в области ионизации уровней, далекой от истощения.

Ход изменений  $R_H(P)$  в  $\text{Si}\langle\text{B}\rangle$  при 80 К и  $P \parallel \langle 100 \rangle, \langle 111 \rangle$  (рис. 1, 6, кривые 1, 2) качественно объясняется с учетом перераспределения легких и тяжелых дырок между соответствующими подзонами и перестройки их изоэнергетических поверхностей при деформации кристалла [4]. Количественного согласования можно ожидать при учете изменения механизмов рассеяния дырок в вырожденных зонах при одноосных нагрузках. При более высоких температурах (200 К) (рис. 1, 6, кривые 3, 4) значительную роль играют переходы в область больших значений  $E(k)$ , где законы дисперсии более сложны и отличны от законов вблизи  $k=0$  [4, 5].

Кривые 5, 6 и 7, 8 (рис. 1, 6) характеризуют изменения  $R_H(P)$  в  $\text{Si}\langle\text{In}\rangle$  и  $\text{Si}\langle\text{e}\rangle$  соответственно с учетом изменения холл-фактора  $r_H(P)$  в исходном материале.

С использованием выражения для концентрации дырок в валентной зоне

$$p = N \exp(E_F/kT), \quad (1)$$

где  $N$  — эффективная плотность состояний,  $E_F$  — положение уровня Ферми, из соотношения  $p(P)/p(0)$  определены зависимости изменения положения уровня Ферми  $\Delta E_F$  от величины одноосной нагрузки, которые приведены на рис. 2, 6. Учет  $N_e(P)$  при этом проводился аналогично изменению  $N_c(P)$  [2] с дополнительным вкладом изменения эффективных масс тяжелых дырок при больших деформациях [4] и уменьшения влияния подзоны легких дырок.

Аналогично [1] для Si, легированного индием, решено уравнение электронейтральности для случая расщепления уровня на две компоненты  $E_{A1}$  и  $E_{A2}$  с величиной  $\Delta E_A = 1.9 \cdot 10^{-11}$  эВ/Па [6] для основных кристаллографических

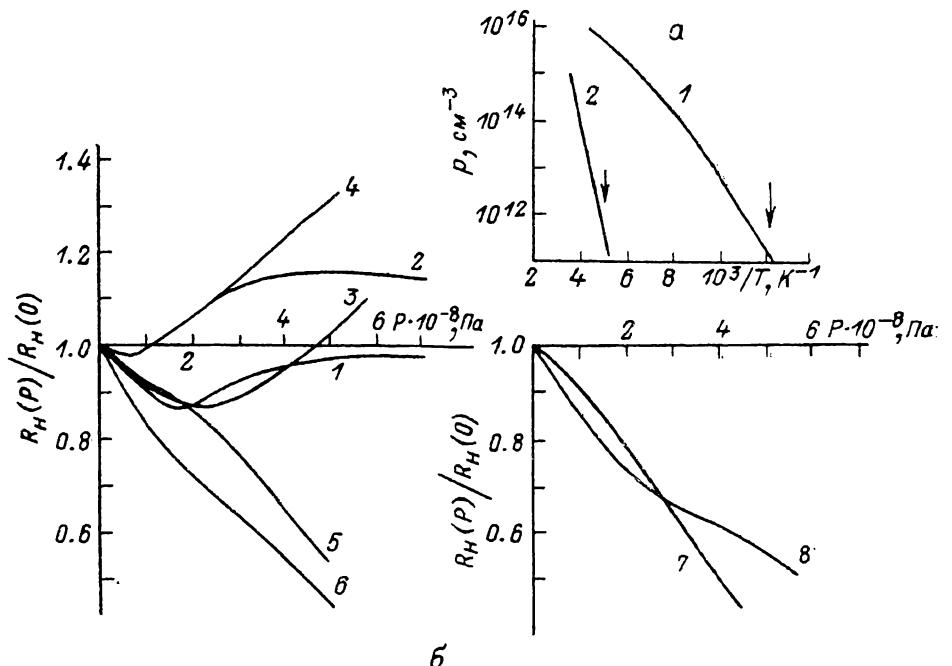


Рис. 1. Температурная зависимость концентрации дырок (а) и зависимости  $R_H(P)$  (б).  
а) 1 — Si<In>; 2 — Si<e>; б) 1—4 — Si<B>; 5, 6 — Si<In>; 7, 8 — Si<e>;  $T, K$ : 1, 2, 5, 6 — 80; 3, 4, 7, 8 — 200; 1, 3, 5, 7 —  $P \parallel \langle 100 \rangle$ ; 2, 4, 6, 8 —  $P \parallel \langle 111 \rangle$ ; 5—8 — с учетом изменения  $R_H(P)$  в соответствующем исходном материале.

ских направлений с учетом снятия электронного вырождения. Сопоставление расчетных и экспериментальных зависимостей  $\Delta E_F(P)$  (рис. 2, б, кривые 1—3) позволило однозначно определить скорости смещения компонент расщепления  $\Delta E_{A1}(P)$  и  $\Delta E_{A2}(P)$  (рис. 2, а) уровня индия по отношению к положению в недеформированном кристалле, которые приведены в таблице.

В облученном электронами  $p$ -кремнии зависимость  $\Delta E_F(P)$  в температурной области ионизации уровня дефекта (200 К) при  $P \parallel \langle 110 \rangle$  линейна, а для других направлений сжатия при  $P < < 0.5 \cdot 10^8$  Па ( $P \parallel \langle 100 \rangle$ ) и  $P < < 1.3 \cdot 10^8$  Па ( $P \parallel \langle 111 \rangle$ ) имеет нелинейный участок (рис. 2, б, кривые 4—6). Такое поведение  $\Delta E_F(P)$  свидетельствует о сложной структуре дефекта и возможном наличии у него ориентационного вырождения. В этом случае при указанных значениях величин нагрузки происходит атомная переориентация дефекта в одну конфигурацию, в результате чего при дальнейшем увеличении нагрузки наблюдается одна компонента уровня дефекта, скорости смещения которой для основных кристаллографических направлений приведены в таблице. Тот факт, что  $\Delta E_F(P)$  для  $P \parallel \langle 110 \rangle$  не имеет нелинейного участка, может быть обусловлен тем, что это кристаллографическое направление является комбинацией направлений  $\langle 111 \rangle$  и  $\langle 100 \rangle$ , имеющих противоположные виды кри-

Тип дефекта	Направление $P$	$\Delta E_{A1} \cdot 10^{11}$ , эВ/Па	$\Delta E_{A2} \cdot 10^{11}$ , эВ/Па
In	$\langle 100 \rangle$	-0.20	1.70
	$\langle 111 \rangle$	-0.80	1.10
	$\langle 110 \rangle$	-0.11	1.89
РД	$\langle 100 \rangle$	-0.55	—
	$\langle 111 \rangle$	-0.70	—
	$\langle 110 \rangle$	-0.63	—

Примечание.  $\Delta E_{A1}$  и  $\Delta E_{A2}$  — скорости смещения расщепившихся компонент уровня дефекта относительно его положения в недеформированном кристалле без учета  $E_{ee}$ .

визны на участке малых нагрузок, либо скорости смещения компонент так малы, что до переориентации дефекта сложно зафиксировать нелинейный участок изменения  $\Delta E_F(P)$ . Поскольку в литературе описано несколько моделей дефектов с энергетическими уровнями в интервале  $E_v + (0.27 \pm 0.33)$  эВ [7, 8], наличие ориентационного вырождения у радиационных дефектов с энергетическим уровнем  $E_v + 0.30$  эВ с относительной легкостью переориентации в одну конфигурацию предполагает содержание вакансионных комплексов в их составе, отдающее, в свою очередь, предпочтение  $K$ -центрам (комплексам вакансия—кислород—углерод [7] или дивакансия—кислород—углерод [8]).

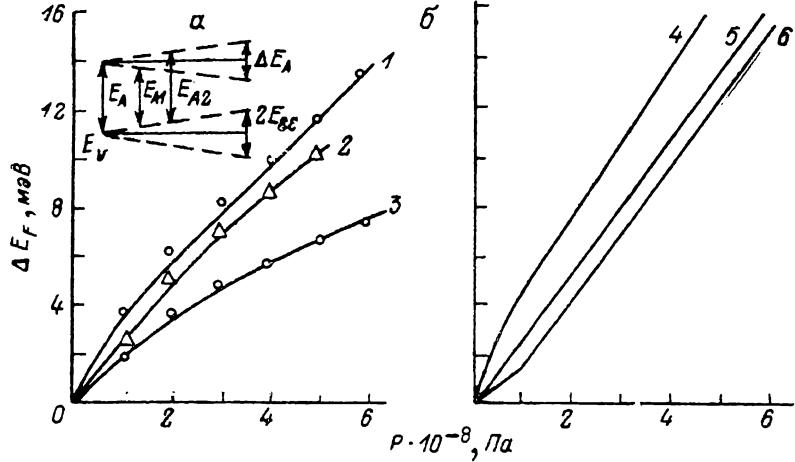


Рис. 2. Энергетическая диаграмма расщепления акцепторного уровня и валентной зоны (а) и зависимость  $\Delta E_F(P)$  (б).

1—3 — Si<In> (80 K);  
линии — расчет; 4—6 — Si<e> (200 K); 1, 4 —  $P \parallel \langle 100 \rangle$ ; 2, 5 —  $P \parallel \langle 110 \rangle$ ;  
3, 6 —  $P \parallel \langle 111 \rangle$ .

Таким образом, исследования пьезо-холл-эффекта в *p*-кремнии показали, что поведение уровня индия в кремнии в условиях одноосной нагрузки достаточно хорошо описывается с учетом снятия электронного вырождения, свидетельствующего о высокой симметрии дефекта. Для дефектов радиационного происхождения с энергетическим уровнем  $E_v + 0.30$  эВ наиболее вероятны наличие ориентационного вырождения и их переориентация в одну конфигурацию при сравнительно малых величинах нагрузок, а также примесно-вакансионная их природа.

#### Список литературы

- [1] Тарасик М. И., Шварков Д. С., Янченко А. М. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 1. С. 97—100.
- [2] Ахмед Шах Бахтери, Тарасик М. И., Шварков Д. С., Янченко А. М. // Вестн. БГУ. Сер. 1. Физ., мат., мех. 1987. № 3. С. 15—19.
- [3] Семенюк А. К., Назарчук П. Ф. // ФТП. 1985. Т. 19. В. 7. С. 1331—1333.
- [4] Бир Г. Л., Пикиус Г. Е. Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках. М., 1969. 590 с.
- [5] Киреев П. С. Физика полупроводников. М., 1969. 590 с.
- [6] Chandrasekhar H. R., Fisher P., Ramdas A. K., Rodriguez S. // Phys. Rev. B. 1973. V. 8. N 8. P. 3836—3850.
- [7] Вопросы радиационной технологии полупроводников / Под ред. Л. С. Смирнова. Новосибирск, 1980. 296 с.
- [8] Lee Y. H., Corbett J. W., Brower K. L. // Phys. St. Sol. (a). 1977. V. 41. N 2. P. 636—647.

Белорусский  
государственный университет  
им. В. И. Ленина  
Минск

Получена 1.12.1988  
Принята к печати 20.02.1989